科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

平成 27 年 5 月 27 日現在

機関番号: 1 4 5 0 1
研究種目: 基盤研究(C)
研究期間: 2012~2014
課題番号: 2 4 5 5 0 2 1 1
研究課題名(和文)高速動作有機CMOS回路の実現に向けた有機トランジスタの基盤技術開発
研究課題名(英文)Basic technology development of organic transistors for high-frequency-operating
研究代表者
北村 雅季(Kitamura, Masatoshi)
神戸大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授
研究者番号:10345142
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,000,000円

研究成果の概要(和文):高速動作有機トランジスタ回路の実現に向けた基盤技術開発の結果,次のような成果を得た。電極表面処理技術と作製プロセスの最適化により短チャネル化が容易なボトムコンタクト型有機トランジスタで移動度 3.3cm2/Vsを達成した。また,酸素プラズマ処理により回路応用に重要となる数Vの範囲での閾値電圧の制御に成功した。さらに,低コンタクト抵抗を実現する表面処理電極について仕事関数と熱安定性について重要な知見を得た。仕事関数については,4.3~5.5 eVの範囲で制御可能であることを示した。

研究成果の概要(英文): The basic technology development for realization of high-frequency operating organic-transistor circuits leaded to the following achievement. Surface treatment for contact electrodes and optimization of fabrication process realized a high mobility of 3.3 cm2/Vs in organic transistors with bottom contact configuration that is easily applied to short channel transistors. Also, threshold voltage control in the range of a few V was demonstrated by oxygen plasma treatment. Furthermore, the work function and the thermal stability of surface-modified electrodes for low contact resistance were investigated. As a result, work functions in the range of 4.3 to 5.5 eV were obtained.

研究分野:半導体デバイス

キーワード: 有機トランジスタ 薄膜トランジスタ 移動度 閾値電圧 仕事関数 表面処理

1. 研究開始当初の背景

有機薄膜トランジスタは低温プロセスで 作製できフレキブルデバイスへの応用が可 能である。さらに移動度 5 cm²/Vs を超える PMOS (正孔がキャリア), NMOS (電子がキャ リア)が実現されておりフレキシブル基板上 への有機 CMOS 回路の実現が期待できる。

これまで我々は PMOS に pentacene, NMOS に C_{60} を使用し,有機 CMOS リングオシレータ で 200 kHz の動作に成功した。これは有機 CMOS 回路としては非常に高い周波数である。しかし,この動作周波数は,有機トランジス タの1 cm²/Vs を超える移動度を十分に発揮した値ではない。

高速動作に向けた短チャネル・高移動度を 実現する上での問題は、短チャネルトランジ スタでの移動度の低下、低電圧領域の低い移 動度, 閾値電圧の高さである。特に, 有機 PMOS ではこの問題が顕著である。有機トランジス タ回路のさらなる高速動作のためにはこれ らを解決する必要がある。

2. 研究の目的

(1)短チャネルトランジスタの際に顕著となるコンタクト抵抗を下げるトランジスタ構造を提案すると共に,作製プロセスを最適化し短チャネル高移動度の有機 PMOS を実現する。

(2)ゲート絶縁膜表面のプラズマ処理による 電流電圧特性の変化を利用し,閾値電圧制御 を試みる。

(3) コンタクト抵抗を下げるのに有効である 金属の表面処理技術を確立する。また、応用 上重要である表面処理電極の仕事関数およ び高温での安定性について調べる。

3. 研究の方法

(1)短チャネル高移動度トランジスタ

高移動度が期待できるアルキル DNTT (C10-DNTT)をチャネル層とし,短チャネル 構造の作製に有利はボトムコンタクト型の トランジスタについて高移動度化を検討す る。電極にはベンゼンチオール誘導体で処理 した金電極を用い,使用するベンゼンチオー ル誘導体に対する移動度の違いを調べる。ま た,作製後,アニール処理による移動度の変 化から移動度の向上を試みる。図1は作製し たボトムコンタクト型 C10-DNTT トランジス タの構造である。



図1 有機トランジスタの構造

(2)酸素プラズマ処理による閾値電圧制御

図2に示したチャネル層にペンタセンを 有する有機トランジスタについて閾値電圧 制御を試みた。基板には熱酸化膜付きシリコ ンを用い,熱酸化膜表面に酸素プラズマ処理 を行った。その条件に対するトランジスタ特 性の変化を調べ,その知見をもとに閾値電圧 の制御を試みた。



図2 作製したトランジスタの構造

(3) 電極表面処理による仕事関数制御 図3のように金表面を種々のベンゼンチ オール誘導体で表面処理し,(b)のような分 子の分極による仕事関数の変化を利用し,仕

事関数の制御を試みた。



図3 表面処理電極の(a)構造と(b)バンド 図,(c)使用したベンゼンチオール誘導体

4. 研究成果

(1)短チャネル高移動度トランジスタ

図1の構造のチャネル長10µmのトランジ スタについて飽和領域での移動度を測定し たところ, PFBT: 2.7, MBT: 1.9, NBT: 1.7, 処理無: 1.6 cm²/Vs であった。このように PFBT 処理した電極を有するトランジスタで 最も高い移動度が得られた。PFBT 処理電極は (3)で示すように仕事関数が大きいため高い 移動度が得られたと考えられる。しかし,次 に示すようにアニールによって移動度が変 化することから,アニールを行わないトラン ジスタの移動度の違いは必ずしも電極の仕 事関数の違いだけでは説明できないことが 分かる。

そこで各電極のトランジスタについてア ニールによる効果を調べた。図4はMBT処理 した電極のトランジスタの電流電圧特性で ある。アニールをしていないトランジスタお よび60,80,100,120℃で1時間アニールを したトランジスタの特性である。図4のよう にアニール温度に依存して電流電圧特性が 変化している。100℃までは電流が増加し, 120℃の温度では減少することが分かった。 アニールを行わなかったトランジスタの特 性では,-1 V 付近で上に凸になるような特 性となっている。アニールによりこの特性が 改善されていることが分かる。



図4 MBT 処理電極を有するトランジスタの 電流電圧特性

図5にアニール温度に対する各トランジ スタの飽和領域の移動度を示した。PFBTのト ランジスタは80℃程度までわずかに移動度 が増加し,100,120℃とアニール温度を高く すると移動度が減少することが分かった。他 の電極のトランジスタについては,100℃ま で移動度が増加し,120℃では減少している。 これらの結果から80~100℃程度のアニール により,どの電極についても移動度が増加し, それ以上の温度では移動度が減少すること が分かった。図5は1時間のアニールによる 結果であるが,さらに移動度の向上を期待し て,長時間のアニールによる変化を調べた。



図5 アニール温度による移動度の変化

図6は各温度で1,10,20,40時間アニー ルを行った場合の移動度である。図のように 長時間のアニールではさらに移動度が向上 する。移動度はほぼ20時間のアニールで飽 和しており,20時間のアニールでは移動度は PFBT:3.3,MBT:3.1,NBT:2.3,処理無:2.6 cm²/Vsであった。MBT処理したトランジスタ の移動度は,PFBT処理したトランジスタの移 動度に近い値を示している。(3)で示すよう に PFBT 処理した金電極の仕事関数は約5.5 eV である。他方, MBT 処理した金電極の仕事 関数は約4.3 eV である。このように PFBT 処 理した金と, MBT 処理した金では仕事関数に 大きな差がある。これより, 飽和領域の移動 度に対しては仕事関数の違いの影響が少な いか, もしくは, アニールにより実効的な仕 事関数が変化している可能性がある。



図6 アニール時間による移動度の変化

間接的であるがアニールによる移動度の 変化の原因を調べるためコンタクト抵抗を 評価した。図7はチャネル長4~40μmのト ランジスタの特性からトランスファ・ライン 法により算出したコンタクト抵抗である。こ こではドレイン電圧-1 V,ゲート電圧から 閾値電圧を引いた値が-8 Vのときについて算 出した。図7のようにアニール温度によって コンタクト抵抗が大きく変わることが分か る。コンタクト抵抗の低下はほぼ移動度の増 加と対応しており,移動度の増加はコンタク ト抵抗の低下による結果であることが分か った。特にMBT および PFBT の100℃のアニー ルのトランジスタでは 350 Ωcm 程度のコン タクト抵抗が得られた。



図7 コンタクト抵抗の変化

(2)酸素プラズマ処理による閾値電圧制御 図8は酸素プラズマ処理に時間を変えた 場合のペンタセントランジスタの電流電圧 特性である。図のように処理時間の増加と共 に電流電圧特性はゲート電圧の正の方向に シフトすることが分かった。他方、|I₀|^{1/2}-V₆ の傾きはほぼ一定である。これより移動度に ついてはほとんど処理時間に依存しないこ とが分かる。実際,移動度は 0.63 から 0.82 cm²/Vs の間の値であった。

図8の特性より閾値電圧を求め、まとめた のが図9である。図のように閾値電圧は処理 時間に対してほぼ線形に変化していること が分かる。閾値電圧の正方向へのシフトから、 プラズマ処理により絶縁膜表面もしくは表 面近くに負の固定電荷が生じたためと考え られる。また、閾値電圧の変化が線形である ことから、その固定電荷はプラズマ処理時間 に対して比例して増加すると考えられる。こ の知見をもとに、プラズマ処理時間により閾 値電圧制御が可能となる。



図8 プラズマ処理時間を変えた場合の 電流電圧特性の変化



図 9 プラズマ処理時間による 閾値電圧の変化

閾値電圧制御の応用としてペンタセント ランジスタを使ってインバータ回路を構成 した。インバータは図10のように2つのト ランジスタからなり、PMOS2の入力は出力側 に接続し、不可として使用する。通常、この ような回路でインバータを構成するために は PMOS2 は正の閾値電圧をもつ必要がある。 図10は異なる閾値電圧のペンタセントラ ンジスタからなるインバータ回路の入出力 特性である。図には3つのインバータ回路の 特性を示したが、それぞれの回路の PMOS1 と PMOS2の閾値電圧 VT1, VT2 は, INV1: -0.7 V, 1.5 V, INV2: -1.6 V, 3.4 V, INV3: -4.2 V, 5.8 V である。図のように INV1 および INV2 ではインバータ動作が得られている。理論式 より予想されるスイッチング電圧は INV1: 7.8 V, INV2: 5.0 V であり, ほぼ測定結果 と一致する。結果として、制御された閾値電 圧のペンタセントランジスタからなるイン バータ回路の動作に成功した。





(3) 電極表面処理による仕事関数制御

図11は各ベンゼンチオール誘導体で表 面処理した金の仕事関数である。図のように 分極の増加と共に仕事関数が低下すること が分かる。仕事関数はおよそ4.3~5.5 eVの 範囲で得られている。表面処理電極を有機デ バイスに応用する場合,ホールの注入には PFBT 処理,電子の注入には DABT 処理が適し ていると言える。

図12に10分間各温度でアニールした場合の表面処理電極の仕事関数を示す。すべての表面処理電極について、アニール温度が高くなるに従い、その仕事関数は表面処理を行わなかった金の仕事関数の値に近づくことが分かる。これは、アニールによりベンゼンチオール誘導体が離脱したためと考えられる。図から400K程度より離脱が始まると言える。

この結果より,表面処理電極をデバイスへ 応用する場合,プロセス温度に注意する必要 があることが分かった。





5. 主な発表論文等

- 〔雑誌論文〕(計4件)
- ① S. Tatara, Y. Kuzumoto, and M. "Wettability control of Kitamura: modified gold surfaces with benzenethiol derivatives: Water contact angle and thermal stability", of Journal Nanoscience and Nanotechnology (印刷中), 查読有
- ② Y. Kuzumoto, H. Matsuyama, and <u>M. Kitamura</u>, "Structural and electrical properties of fluorinated copper phthalocyanine toward organic photovoltaics: post-annealing effect under pressure", Japanese Journal of Applied Physics, vol. 53, pp. 04ER16-1-5, 2014, DOI: 10.7567/JJAP. 53. 04ER16, 査読有
- ③ Y. Kuzumoto and <u>M. Kitamura</u>, "Work function of gold surfaces modified using substituted benzenethiols: Reaction time dependence and thermal stability", Applied Physics Express, vol. 7, pp. 035701-1-4, 2014, DOI: 10.7567/APEX.7.035701, 査読有
- ④ <u>M. Kitamura</u>, Y. Kuzumoto, and Y. "Short-channel, Arakawa, high-mobility organic thin-film transistors with alkylated dinaphthothienothiophene", Physica Status Solidi (c), vol. 10, pp. 1632 - 1635,2013, DOI: 10.1002/pssc.201300245, 査読有

〔学会発表〕(計30件)

- <u>北村雅季</u>, "有機薄膜トランジスタの研究開発と実用化に向けた展望",電子情報通信学会総合大会,2015.3.10-13,立 命館大学(滋賀県)(依頼講演)
- ② S. Tatara and <u>M. Kitamura</u>, "Wettability control of gold surfaces modified with benzenethiol derivatives", 11th International Conference on Nano-Molecular Electronics, 2014.12.17-19, 神戸国際 会議場(兵庫県)
- ③ <u>M. Kitamura</u>, Y. Kuzumoto, and Y. Arakawa, "Annealing effect on field-effect mobilities in bottom-contact alkylated dinaphthothienothiophene transistors", International Conference on Solid State Devices and Materials, 2014.9.8-11, つくば国際会 議場 (茨城県)
- ④ Y. Kimura, <u>M. Kitamura</u>, and Y. Arakawa, "Pentacene thin-film transistors with controlled threshold voltages and their application to pseudo CMOS inverters", International Conference

on Solid State Devices and Materials, 2014.9.8-11, つくば国際会議場(茨城 県)

- ⑤ M. Kitamura, "Solution-processed organic thin-film transistors", 6th Asian Coating Workshop, 2014.5.8-9, 神 戸大学(兵庫県)(招待講演)
- ⑥ M. Kitamura and Y. Arakawa, "Thermal stability of short channel, high-mobility organic thin-film transistors having bottom-contact configuration", International Conference on Solid State Devices and Materials, 2013. 9. 24-27, ヒルトン福岡 シーホーク (福岡県)
- ⑦ M. Kitamura, Y. Kuzumoto, and Y. Arakawa, "Short-channel, high-mobility organic thin-film transistors with alkylated dinaphthothienothiophene", 40th International Symposium on Compound Semiconductors, 2013.5.19-23, 神戸国 際会議場(兵庫県)
- (8) Y. Kimura, K. Katsuki, M. Kitamura, and "Threshold voltage Υ. Arakawa, control in pentacene thin-film transistors by oxygen plasma treatment", 40 thInternational Symposium on Compound Semiconductors, 2013.5.19-23, 神戸国際会議場(兵庫県)
- ⑨ M. Kitamura and Y. Arakawa, "Dinaphthothienothiophene thin-film transistors with aluminum/molybdenum oxide electrodes", 7th International Conference Molecular Electronics and Bioelectronics, 2013.3.17-19, 福岡国 際会議場(福岡県)
- 11.11
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.12
 11.
- M. Kitamura, Y. Tanaka, W. Kang, and Y. Arakawa, "Dinaphtho thieno thiophene thin-film transistors with modified platinum electrodes in bottom-contact configuration", International Conference on Solid State Devices and Materials, 2012. 9. 25-27, 京都国際会議 場 (京都府)

〔その他〕 ホームページ等 http://www2.kobe-u.ac.jp/[~]mkita/

6.研究組織
(1)研究代表者
北村 雅季(KITAMURA, Masatoshi)
神戸大学・大学院工学研究科・准教授
研究者番号:10345142